BL46XU

放射光 X 線ラミノグラフィーを用いた Zn 系めっき上腐食生成物の 非破壊観察

Nondestructive Observation of Corrosion Products on Zn Based Coating Using Synchrotron Radiation X-ray Laminography

<u>吉住 步樹</u>^a, 西原 克浩^a, 谷山 明^a, 梶原 堅太郎^b <u>Ayuki Yoshizumi^a, Katsuhiro Nishihara^a, Akira Taniyama^a, Kentaro Kajiwara^b</u>

^a日本製鉄株式会社,^b高輝度光科学研究センター ^aNippon Steel Coorporation, ^bJapan Synchrotron Radiation Research Institute

Zn 系めっき組織や腐食生成物の非破壊観察技術の確立を目的として、複合サイクル腐食試験(塩 水噴霧、乾燥および湿潤の繰り返し)を行った Zn-5%Al 合金めっき鋼板に対して X 線ラミノグラ フィー測定を行った。2 種類の入射 X 線のエネルギーで実験を行い、腐食生成物の構造を鮮明に 観察するための測定条件を検討した。結果、いずれのエネルギーの X 線でも腐食生成物と空隙の 明瞭な識別と、腐食生成物の種類の違いを形状の違いとして見分けることができた。一方で検討 した X 線エネルギーでは、腐食生成物の種類の違いを像コントラストの違いとして識別すること はできなかった。また、両者の X 線エネルギーにおける空隙部と腐食生成物とのコントラストは、 線吸収係数の違いほど大きな差にならなかった。再構成画像の鮮明さは線級数係数の大小で一義 的に決まるものではなく、試料の厚さと入射 X 線のエネルギーとのバランスが重要であると考え られる。

キーワード: Zn 系合金めっき鋼板、放射光 X 線ラミノグラフィー、腐食生成物

背景と研究目的:

Zn 系めっき鋼板の長期間にわたる耐食性能を維持するためには、Zn 系めっき層の腐食生成物 (酸化物や水酸化物などの無機化合物)による耐食性付与が重要となる。一般に Zn 系めっき鋼板 の腐食反応は、Zn 系めっき層の腐食反応(τ 1)、Zn 系めっきの Fe に対する犠牲防食作用(τ 2)、腐食 生成物の Fe に対する遮蔽防食作用(τ 3)、および鋼板の腐食反応(τ 4)の4 段階で進行する[1]。長期間 の耐久性を必要とする場合は τ 2 の期間を長くする必要があり、意匠性を重視する場合は τ 1 の期 間を長くすることが重要である。このように、用途によって Zn 系めっきに求められる耐食性能は 異なる。しかしながら、 τ 1~ τ 4 における腐食機構には不明な点が多い。

これまで、腐食初期における腐食進行に伴う腐食生成物の構造変化については、励起エネルギーによる検出深さの違いを利用した光電子分光、あるいは光電子分光と赤外分光を相補活用することによって、表面から深さ 10 nm 程度、あるいは数 µm 程度における腐食生成物の構造変化から、Zn 系合金めっきの腐食反応機構が調べられてきた[2-3]。

しかしながら、腐食が進行すると表面には数 µm~数+µm の凹凸が形成され、試料表面は不均 ーに帯電することから、光電子分光法による分析は困難である。また、Zn 系めっきの赤外分光に よる分析は主に反射法が用いられるが、凹凸のある試料の場合、散乱光による影響が大きくなる ため、赤外分光による分析も困難である。他には、試料の切断面を顕微鏡等で観察し、腐食生成物 の種類や凹凸形状を分析する手法もあるが、試料断面の観察は破壊分析のため、同一試料を腐食 させた際の経時変化を追跡することはできない。従って、Zn 系めっき鋼板の腐食反応機構を明ら かにするためには、試料表面における腐食生成物の元素組成や構造だけでなく、腐食生成物の内 部、ならびに腐食生成物とめっきや鋼板の界面における元素組成や構造を広い視野で非破壊かつ 3 次元的に調査する必要がある。

そこで、上記の分析課題を解決するため、平板試料の非破壊分析に適した放射光 X 線ラミノグ ラフィー法を用いて、Zn 系めっき鋼板上の腐食生成物を非破壊分析するための技術確立を目的と して実験を行った。本課題では、入射エネルギーの異なる X 線を用いて実験を行い、あらかじめ 腐食試験を施した Zn 系めっき鋼板の腐食生成物と空隙の分離ならびに腐食生成物の構造を可視 化する実験条件の検討を行った結果について報告する。

実験:

供試材として、Zn-5%Al めっき鋼板(mass%)を使用した。めっき厚は約30µmである。鋼板に は表面への塩水噴霧(35℃、5wt% NaCl 水溶液、2時間噴霧)、乾燥(大気中60℃、湿度20~30%、 4時間暴露)、および湿潤(大気中50℃、湿度90%以上、2時間暴露)を繰り返す複合サイクル腐 食試験(JASO M609)を30回繰り返し、腐食生成物を発生させた。その後、供試材を10 mmΦ に 打ち抜き、腐食生成物の剥離を防ぐため、腐食生成物が形成された面を樹脂で被覆した後、腐食生 成物が形成されていない面を油性研磨して、試料厚さを0.4 mmに調整したものを測定試料とした。

実験は、SPring-8 BL46XUで実施した。図1に装置外観を示す。X線ラミノグラフィー法は、試 料の回転軸とX線の光軸が直交するX線CT法とは異なり、試料の回転軸とX線の光軸とのなす 角を 90°より小さくして測定する。 本実験においては、BL46XU に常設された X 線ラミノグラフィ ー装置を用いた。測定試料は、X-Y-Z ステージ上に回転ステージ(θ=0~360°)と傾斜ステージ(ω =15°±20°)に取り付けられた試料ステージに設置した。また、測定視野と試料厚さとのバランスを 考慮して、傾斜角はω=30°とした。試料ステージは図2に示す様に、アクリル製の筒と中空の円 盤状のアルミ板からなり、回転ステージ上に取り付けた。アルミ板の中空部分に測定試料が来る ように位置を調整し、樹脂テープで貼り付けた。X線は、Si(111)結晶を用いた液体窒素冷却二結 晶モノクロメータで単色化された後に、Rh 蒸着した2枚の全反射ミラーで高調波が除去されたも のを試験片に入射した(ビーム径:1.0×0.8 mm)。本実験では、腐食生成物の分離が可能と考えら れるエネルギーと、試料の透過強度のバランスを考え、X線エネルギーが 25 keV および 37 keVの エネルギーを用いて測定を行った。測定に当たって、検出器のシャッターを閉じた状態で測定し た、暗電流由来のノイズを反映した画像(以下、暗電流画像)と、試料無しで直接光を撮影した画 像(以下、ダイレクト画像)、試料の透過像の3種類の画像を取得した。暗電流画像は試料の測定 前後で1枚ずつ、ダイレクト画像は 60 枚取得した。試料の透過像について、試料を 0°から 360°ま で連続的に回転させながら約4000枚のX線透過像を取得した。検出器は、X線イメージングユニ ット(シグマ光機製)と浜松ホトニクス製 CMOS カメラ ORCA-Flash4.0 を組み合わせて用いた。 カメラ長は 40 mm とし、透過像1枚当たりの露光時間は、ダイレクト画像の透過光強度が CMOS カメラのダイナミックレンジを超えない範囲で、強度の高くなる条件で決定し、25 keV で 200 ms、 37 keV で 30 ms とした。この構成における検出器の実効的な画素サイズは 0.45 µm であった。ま た、断面像の再構成にはフィルター補正逆投影法(Filtered Back Projection)を用いた[4]。



図 1.X 線ラミノグラフィー装置外観



図 2.X 線ラミノグラフィー測定の様子

結果および考察:

図3には試料の断面方向から見た、X線ラミノグラフィー法による再構成画像領域の模式図を 示す。画像再構成は、試料の回転角度に関わらずX線が照射される範囲に対して実施したため、 再構成領域は双円錐状となる。図3において、Zn-5%Alめっき鋼板表面に形成された腐食生成物 の表層(腐食生成物と空隙が混在する層)の再構成を行った。図4にX線エネルギーが25keV、 図5にX線エネルギーが37keVにおける再構成画像を示す。いずれも、試料板厚方向を試料の 回転軸(Z^{*})とした、X^{*}Y^{*}Z^{*}空間におけるX^{*}Y^{*}断面像である。図中の明るく見える領域は腐食 生成物を示し、暗い領域は空隙部分を示す。ここで、再構成画像には同心円状の模様が見られる が、これは検出器の一部の画素が非線形な応答を示すことによって現れるアーティファクトであ る。いずれのエネルギーで測定した場合においても、腐食生成物と空隙がそれぞれ可視化され、腐 食生成物は塊状のものと環状のものの2種類存在することが確認された。一方で、酸化の進行度 や腐食前のめっき組織の違いによる、腐食生成物の種類を確認することはできなかった。

一般に、X 線ラミノグラフィー法による再構成は不完全なため、再構成画像の画素値から内部 構造の線吸収係数の絶対値を求めることはできないが、条件を変えて測定した場合の相対的な大 小関係は変わらない。従って、再構成画像のコントラストは物質の線吸収係数が大きな低エネル ギーの X 線で測定された画像の方が大きくなると期待される。図4および図5を比較すると、図4 の方が、腐食生成物と空隙とのコントラストが大きいように見られるが、腐食生成物の種類を識 別できるほどの差は得られていない。そこで、腐食生成物の領域と空隙部の画素値から、入射 X 線のエネルギーによる、空隙と腐食生成物とのコントラストの違いを評価した。腐食生成物の領 域における平均画素値を g_{cor} 、空隙部の平均画素値を g_{air} とすると、コントラストC は、式(1)の ように表される。

$$C = \frac{g_{\rm cor} - g_{\rm air}}{g_{\rm cor} + g_{\rm air}} \tag{1}$$

X線のエネルギーが 25 keV と 37 keV における g_{cor} 、 g_{air} ならびにコントラスト *C* を表 1 に示 す。ここで、 g_{cor} 、 g_{air} は図 4、5の腐食生成物(白枠)と空隙(黄枠)の領域における値の平均値を計算した。25 keV は 37 keV より約 6%良いコントラストが得られている。ここで、腐食生成物を ZnO と仮定すると、X線エネルギーが 25 keV、37 keV での線吸収係数 μ_{ZnO} はそれぞれ 84.94 cm⁻¹、30.16 cm⁻¹である[5]。表 1 の結果からは、2 種類のエネルギーにおける線吸収係数の違いほど、コントラストに大きな差は見られなかった。

次に再構成画像の質について考えると、ノイズの大小について評価する必要がある。ここでは、 X線エネルギーが25 keV および37 keV における再構成画像のSN 比の評価を行った。SN 比は腐 食生成物と空隙の画素値の差を、空隙の画素値の標準偏差 σ で除することで求められる。表2 に X線のエネルギーが25 keV、37 keV での σ およびSN 比を示す。25 keV では σ が大きく、SN 比 が低く、37 keV の画像の方が約1.3 倍鮮明であると評価された。これはX線のエネルギーが小さ いほど線吸収係数が大きく、鮮明な画像が得られやすいとする説とは逆の結果を示している。図4 や図5 に示す再構成画像はX線の透過像から計算されるため、X線透過像のSN 比が再構成画像 のSN 比に影響を与えていると考え、算出を試みた。

X線の透過像において、フォトンノイズが支配的な場合、n個のフォトンを計測すると、ノイズ

は \sqrt{n} で表される。従って、SN 比は $n/\sqrt{n} = \sqrt{n}$ となる[6]。計測されるフォトン数と、X 線の透過 強度は比例するため、各エネルギーにおける X 線の透過強度から、透過像の SN 比を計算するこ とができる。X 線の透過強度 I は、X 線の物質 A における透過距離を t_A 、物質 B における透過距 離を t_B 、物質 A、B の線吸収係数をそれぞれ μ_A 、 μ_B とし、X 線の試料中の透過距離に占める空隙 の割合を x、入射 X 線の強度が I_0 とすると、

$$I = I_0 \exp\{-\mu_A t_A (1-x)\} \exp\{-\mu_B t_B (1-x)\}$$
(2)

で表される。ここで、物質 A、B をそれぞれ ZnO、Fe₂O₃ と仮定し、空隙の割合を x = 0.3 とする。 $\omega = 30^{\circ}$ のため、 $t_{ZnO} = 0.006$ (cm)、 $t_{Fe_{2}O_{3}} = 0.074$ (cm) となる。また、X 線エネルギーが 25 keV、 37 keV での線吸収係数 $\mu_{Fe_{2}O_{3}}$ はそれぞれ 48.41 cm⁻¹、15.24 cm⁻¹ である[5]。 I_{0} はダイレクト画像の 光子数から計算することができる。また、光子数は検出器の各ピクセルの強度の和から求めるこ とができる。25 keV および 37 keV における I_{0} はそれぞれ、1.54×10¹² count、7.22×10¹¹ count であ った。従って、式(2) をそれぞれのエネルギーで計算すると、25 keV で 8.76×10¹⁰、37 keV で 2.89×10¹¹ となった。SN 比は \sqrt{I} で計算でき、25 keV で 2.96×10⁵、37 keV で 5.38×10⁵ となっ た。よって、37 keV は 25 keV より約 1.8 倍 SN 比がよい結果となり、再構成画像から得られた約 1.3 倍と近い結果が得られた。

従って、X線エネルギーが25keVと37keVで得られたコントラストの差が、線吸収係数の違い ほど大きくならなかった原因は、X線の透過像におけるSN比の影響によるものと推定される。そ のため、実験で得られる画像の鮮明さは線級数係数の大小で一義的に決まるものではなく、測定 対象物の透過強度およびノイズにも影響される。透過強度は試料厚さに影響され、ノイズは取得 された平均光子数に影響されるため、よりコントラストの大きい像を得るには、試料の厚さと入 射X線のエネルギーとのバランスを考慮する必要があると考えられる。

次に、腐食生成物の構造について考察する。Zn-5%Al めっき鋼板では、溶融めっきの製造工程 で、Zn相、Zn-Al 共晶組織、の2種類が形成される[7]。Zn相は溶融めっきの凝固過程において初 めに晶出するため、塊状をしていると推測される。その後、凝固が進むとZn-Al 共晶組織が得られ る。Zn相が晶出する際、周辺のZn 濃度は低下し、相対的にAl 濃度は高くなると考えられる。従 って、Zn-Al 共晶組織では、Zn相に近い側がAl 濃度が高く、Zn相から離れたところは前者に比 べてAl 濃度が低いと考えられる。図4および図5を見ると、腐食生成物は塊状に形成された部分 と環状に形成された部分の2種類が存在する。Zn-Al めっきは、大気放置で表面にZn酸化物とAl 酸化物を含む自然酸化皮膜が形成される。特にAl 酸化物は強固な不働態皮膜を形成すると考えら れ、皮膜中のAl 酸化物の比率が高いほど、耐食性は高くなると考えられる。従って、Zn 相はZn-Al 共晶組織よりも腐食しやすく、Zn 相上には全面に腐食生成物が形成すると考えられる。一方で、 Zn-Al 共晶組織は不働態皮膜の影響により酸化しにくく、Zn-Al 相どうしの境界やZn 相との境界 で腐食が進行すると推測される。従って、塊状の腐食生成物はZn が主成分の腐食生成物であり、 環状の腐食生成物は塊状の腐食生成物と比べて比較的Al 濃度の高い酸化物であると推測される。

試みに、Zn相上の塊状の酸化物をZnOとし、ZnO相周辺のAl濃度がめっき鋼板の重量比の2 倍程度に濃化して、ZnO+Al₂O₃(Zn:Al=9:1,mass%)の環状の酸化物が形成されたと仮定す る。Al₂O₃の線吸収係数はX線エネルギーが25keVと37keVではそれぞれ4.824 cm⁻¹と1.97 cm⁻¹ であり、環状酸化物の線吸収係数は、25keVと37keVでそれぞれ71.87 cm⁻¹と25.57 cm⁻¹になる [5]。これらの値は、塊状の酸化物の線吸収係数と比べてどちらも約15%の差がある。しかしなが ら、表1の結果より、腐食生成物と空隙の画素値の差を100%としたとき、期待される環状と塊状 の腐食生成物の画素値の差は、0.5~0.6程度であり、これは表2に示すノイズと比べて小さな値と なるため、実際の2種類の酸化物を見分けるためには、より大きなコントラストの得られる条件 で測定する必要があると考えられる。例えば、母材である鋼板側を研磨し、試料厚さを薄くするこ とによるX線の透過強度の増加、あるいは、X線透過像の投影枚数の増加が、コントラスト改善 の方法として考えられる。



図 4. X 線エネルギーが 25 keV で測定した Zn-5%Al めっき鋼板表面の再構成画像



図 5.X線エネルギーが 37 keV で測定した Zn-5%Al めっき鋼板表面の再構成画像

表1. 腐食生成物、空隙の画素値とコントラスト

X 線エネルギー	25 keV	37 keV	
画素値(腐食生成物)	29.2	26.4	
画素値 (空隙)	22.9	21.0	
コントラスト	0.12	0.11	

表 2. 再構成画像のノイズおよび S/N 比

私 2. 行時成画像のアイ ハねより 5.1 L			
X 線エネルギー	25 keV	37 keV	
ノイズ	10.2	6.75	
SN 比	0.62	0.80	

まとめ:

本報告では、平板試料の非破壊分析に適した放射光 X 線ラミノグラフィー法を用いて、Zn 系め っき鋼板上の腐食生成物を 2 種類の異なるエネルギーで測定し、Zn-5%Al 合金めっき鋼板上に形 成された、腐食生成物の構造を鮮明に観察するための測定条件を検討した。結果、いずれのエネル ギーの X 線でも腐食生成物と空隙の明瞭な識別と、腐食生成物の種類の違いを形状の違いとして 見分けることができた。一方で検討した X 線エネルギーでは、腐食生成物の種類の違いを像コン トラストの違いとして識別することはできなかった。腐食生成物の種類の違いを識別するには、 より高コントラストで測定する条件を検討する必要がある。また、両者の X 線エネルギーで取得 した再構成画像の空隙部と腐食生成物とのコントラストは、X 線エネルギーによる線吸収係数の 違いほど大きな差とはならなかった。再構成画像の画素値の標準偏差からノイズを評価したとこ ろ、X 線エネルギーが 25 keV の方がノイズが大きく、SN 比が低くなることを知見した。そのた め、再構成画像の鮮明さは線級数係数の大小で一義的に決まるものではなく、試料の厚さと入射 X 線のエネルギーとのバランスが重要であると考えられる。

参考文献:

[1] S. Fujita et al., GALVATECH98, ISIJ, Chiba, 686 (1998).

[2] 西原克浩他、材料と環境, 57, 76 (2008).

[3] 西原克浩 他、材料と環境, 56, 314 (2007).

- [4] 星野真人 他、放射光, 26(5), 257 (2013).
- [5] https://physics.nist.gov/PhysRefData/FFast/html/form.html (Accessed December 10, 2023).
- [6] 戸田裕之 他、顕微鏡, 44(3), 199 (2009).
- [7] 喜安哲也他、鉄と鋼, 72(8), 1005 (1986).

(Received: May 12, 2024; Accepted: August 10, 2024; Published: October 31, 2024)